



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206466632 U

(45)授权公告日 2017.09.05

(21)申请号 201720105552.8

(22)申请日 2017.01.25

(73)专利权人 广东昊晟陶瓷有限公司

地址 511500 广东省清远市清新区禾云镇
云龙陶瓷产业基地A区3号

(72)发明人 施先发 王明勇 李海华 邓立传

(74)专利代理机构 广州市越秀区海心联合专利
代理事务所(普通合伙)
44295

代理人 龚元元

(51)Int.Cl.

B65G 35/00(2006.01)

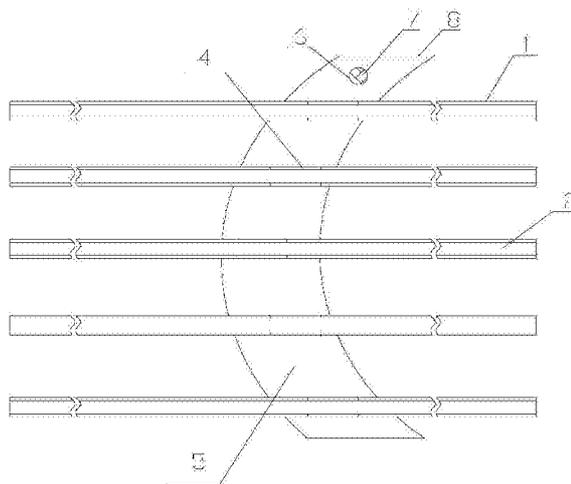
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置,包括多个平行布置的轨道,所述的轨道上设有通过电机驱动的输送条,所述的输送条的截面为圆形,所述的轨道上表面设有与输送条形状适应的滑轨,每一个轨道上都设有一个凹部,多个凹部呈圆弧形布置,所述的多个平行布置的轨道下方设有一个弧形的釉液回收槽;所述的釉液回收槽位于凹部的正下方。本实用新型的目的是提供一种布釉均匀、瓷砖背面粘附的釉液少、釉液回收率高的一种大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置。



1. 一种大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置,包括多个平行布置的轨道,所述的轨道上设有通过电机驱动的输送条,其特征在于,所述的输送条的截面为圆形,所述的轨道上表面设有与输送条形状适应的滑轨,每一个轨道上都设有一个凹部,多个凹部呈圆弧形布置,所述的多个平行布置的轨道下方设有一个弧形的釉液回收槽;所述的釉液回收槽位于凹部的正下方。

2. 根据权利要求1所述的大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置,其特征在于:所述的凹部为下凹的圆弧形凹部。

3. 根据权利要求2所述的大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置,其特征在于:所述的釉液回收槽的末端的底面设有一个排釉口,所述的排釉口上设有以可拆卸的方式设置有过滤网,釉液回收槽的末端的端部设有一个挡板。

4. 根据权利要求3所述的大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置,其特征在于:所述的排釉口距离釉液回收槽的末端的端部的距离为3-5cm,所述的排釉口的高度高于釉液回收槽的末端的端部1-2cm,所述的釉液回收槽的末端的底面从排釉口至釉液回收槽的末端的端部向下倾斜。

一种大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及瓷砖生产设备领域,特别是一种大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置。

背景技术

[0002] 大理石瓷砖,是指具有天然大理石逼真纹理、色彩和质感的一类瓷砖产品,其具有天然大理石逼真的装饰效果和瓷砖的优越性能,摒弃天然大理石的天然缺陷,它是建陶行业划时代的革新者,也是现代顶级瓷砖制造工艺的代表作,是继瓷片、抛光砖、仿古砖、微晶石瓷砖之后的又一瓷砖新品类。

[0003] 大理石瓷砖在纹理、色彩、质感、手感以及视觉效果完全达到天然大理石的逼真效果,装饰效果甚至优于天然石材,大理石瓷砖凭借逼真的装饰效果和优越的实用性能赢得广大消费者的青睐,已发展成为瓷砖领域的主流产品之一。

[0004] 大理石瓷砖在施布表面釉和底层釉的过程中,釉液并不会间歇性的输出,相反其采用连续性的输出方式以保证釉幕的连续性和均匀性,但是瓷砖输送是间歇性的,因此如何保证在布釉过程中平稳的输送釉液到瓷砖上、如何降低瓷砖背面釉液粘附、如何降低釉液损失是本申请需要着重考虑的内容。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种布釉均匀、瓷砖背面粘附的釉液少、釉液回收率高的一种大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置。

[0006] 本实用新型提供的技术方案为:一种大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置,包括多个平行布置的轨道,所述的轨道上设有通过电机驱动的输送条,所述的输送条的截面为圆形,所述的轨道上表面设有与输送条形状适应的滑轨,每一个轨道上都设有一个凹部,多个凹部呈圆弧形布置,所述的多个平行布置的轨道下方设有一个弧形的釉液回收槽;所述的釉液回收槽位于凹部的正下方。

[0007] 在上述的大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置中,所述的凹部为下凹的圆弧形凹部。

[0008] 在上述的大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置中,所述的釉液回收槽的末端的底面设有一个排釉口,所述的排釉口上设有以可拆卸的方式设置有过滤网,釉液回收槽的末端的端部设有一个挡板。

[0009] 在上述的大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置中,所述的排釉口距离釉液回收槽的末端的端部的距离为3-5cm,所述的排釉口的高度高于釉液回收槽的末端的端部1-2cm,所述的釉液回收槽的末端的底面从排釉口至釉液回收槽的末端的端部向下倾斜。

[0010] 本实用新型在采用上述技术方案后,其具有的有益效果为:

[0011] 1.与现有技术相比,本方案输送条的截面为圆形,这样瓷砖下表面和输送条的接

触面积小,凹部的存在防止滑轨内过多的积存釉液,这样结合可以降低釉液在瓷砖背面的粘附,弧形的釉液回收槽和多个凹部的圆弧形相匹配,这样就可以收集多个凹部流下来的釉液,也就是说该弧形的釉液回收槽和外设的布釉的布釉罩的边缘形状是相适应的,需要说明的是,布釉罩为向上凸起的弧面。

[0012] 2.与现有技术相比,下凹的圆弧形凹部可以更为有效的将釉液集中在凹部的最低处;对于含有颗粒杂质的釉液的回收尤为重要,其能够将釉液集中在釉液回收槽的中部,便于后期的收集;

[0013] 3.与现有技术相比,排釉口与釉液回收槽的末端的端部预留一定的距离,这样便于釉液中的固体杂质能够积存在该距离形成空间中;

[0014] 4.与现有技术相比,釉液回收槽的末端的底面向下倾斜有利于釉液和杂质的分离。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型实施例1的俯视图;

[0016] 图2是本实用新型实施例1的单个轨道的主视图;

[0017] 图3是本实用新型实施例1的图2的A-A剖视图。

具体实施方式

[0018] 下面结合具体实施方式,对本实用新型的技术方案作进一步的详细说明,但不构成对本实用新型的任何限制。

[0019] 实施例1:

[0020] 如图1至3所示,一种大理石瓷砖布釉工序中输送瓷砖和回收釉液的装置,包括多个平行布置的轨道1,所述的轨道1上设有通过电机驱动的输送条2,所述的输送条2的截面为圆形,所述的轨道1上表面设有与输送条2形状适应的滑轨3,每一个轨道1上都设有一个凹部4,多个凹部4呈圆弧形布置,所述的多个平行布置的轨道1下方设有一个弧形的釉液回收槽5;所述的釉液回收槽5位于凹部4的正下方。

[0021] 具体来说,所述的凹部4为下凹的圆弧形凹部4,所述的釉液回收槽5的末端的底面设有一个排釉口6,所述的排釉口6上设有以可拆卸的方式设置有过滤网7,釉液回收槽5的末端的端部设有一个挡板8,所述的排釉口6距离釉液回收槽5的末端的端部的距离为3-5cm,所述的排釉口6的高度高于釉液回收槽5的末端的端部1-2cm,所述的釉液回收槽5的末端的底面从排釉口6至釉液回收槽5的末端的端部向下倾斜。

[0022] 在使用过程中,本装置的上方布置有一个向上凸起的弧面布釉罩,釉液从布釉罩的顶点输出并从布釉罩的边缘流下来,这样就到达了凹部4的位置,经过釉液回收槽5收集并过滤后进行回收,在此过程中,圆弧形凹部4可以使釉液中的固体杂质分布在釉液回收槽5的中间位置,便于收集,同时,还有大部分的固体杂质会进入到排釉口6和挡板8之间的空间中,这样有利于釉液的分离和回收。

[0023] 上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其它的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。

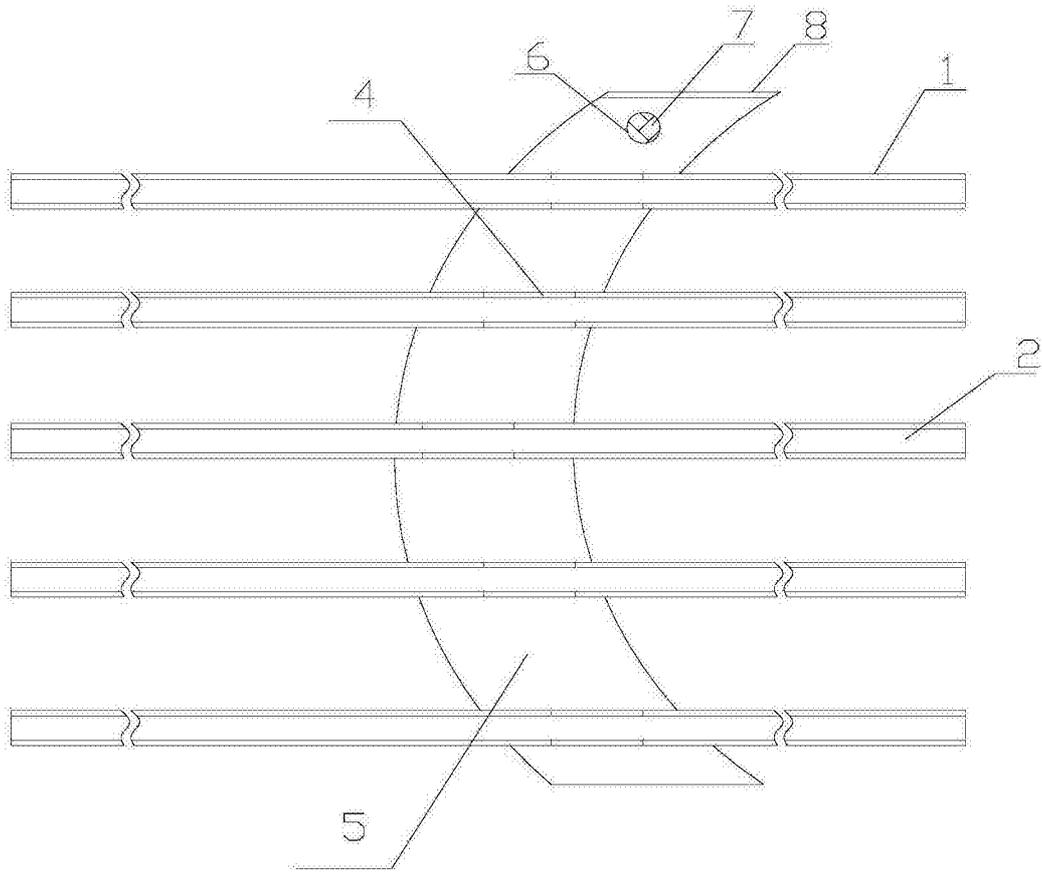


图1

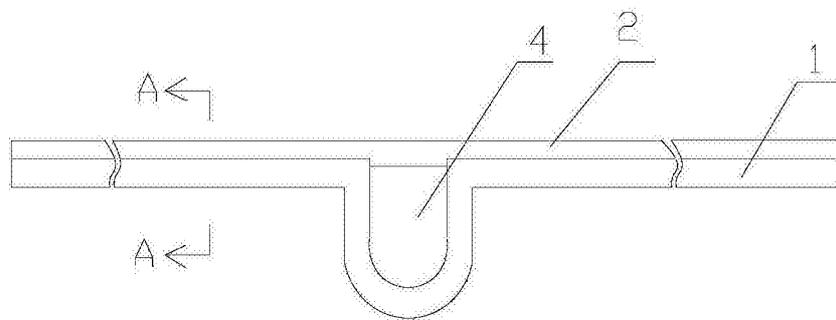


图2

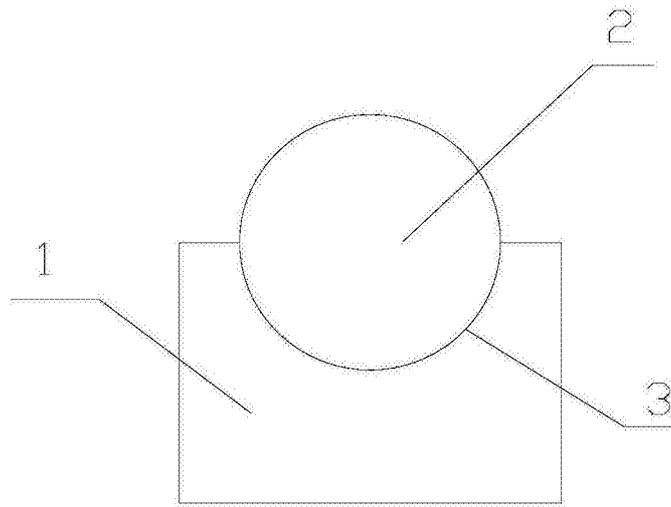


图3